

表面科学技術研究会 2026
PFAS 規制の動向と代替技術の展望

主 催： 一般社団法人 表面技術協会 関西支部、公益社団法人 日本表面真空学会 関西支部
協 賛： 応用物理学会、応用物理学会関西支部、化学工学会、高分子学会、電気化学会、電気化学会関西支部、日本機械学会、日本材料科学会、日本太陽エネルギー学会、日本物理学会、日本油化学会、触媒学会、精密工学会、腐食防食学会、日本トライボロジー学会、日本金属学会、日本材料学会関西支部、日本化学会、日本分析化学会、日本セラミックス協会、光化学協会、光触媒工業会、大阪府技術協会、大阪工研協会、電気鍍金研究会（予定）
日 時： 2026 年 1 月 23 日（金）13:00 ～ 17:20
場 所： 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 森之宮センター 大講堂（大阪市）
ならびに、ZOOM によるオンライン配信
定 員： 会場 80 名、オンライン 100 名
参加費： 参加費：2,000 円（日本表面真空学会会員及び表面技術協会会員ならびに協賛団体会員）
3,000 円（上記以外の一般参加者）
学生：無料

内 容： PFAS は撥水性、耐油性、耐熱性といった優れた特性を有することから、食品分野、防汚加工、消火剤、半導体製造、医療用具等幅広い用途で利用されてきました。しかし、極めて分解されにくく「永遠の化学物質(Forever Chemicals)」とも呼ばれ、環境中への残留などが懸念されることから、今後の規制動向に大きな注目が集まっています。

このような状況を踏まえ、表面科学技術研究会 2026 では、「PFAS 規制の動向と代替技術の展望」をテーマに、PFAS の環境への影響評価やその代替技術の研究において第一線で活躍されている研究者を招き、講演会を開催いたします。基調講演では、PFAS 汚染に関する近年の動向を総括し、依頼講演では、様々な分野の最先端の技術について深掘りします。表面、半導体産業に分野にご関心の方を含め、多数のご参加をお待ちしております。

講演プログラム（仮）：

- 開会の挨拶 藤田 直幸（表面技術協会 関西支部 支部長）
1. [基調講演] PFAS 汚染に関する近年の動向
原田 浩二 先生（京都府立大学）
 2. [依頼講演 1] DIC 界面活性剤の機能発現のメカニズムと高性能 PFAS フリー界面活性剤の開発
植野 純平 氏（㈱DIC）
 3. [依頼講演 2（オンライン）] PFAS 汚染解決に向けた新技術「LED を用いたフッ素化合物分解」
その開発動向と実用化に向けた取り組みについて
小林 洋一 先生（立命館大学）
 4. [依頼講演 3（オンライン）] PFAS および関連指標の分析法と最新研究
田中 周平 先生（京都大学）
- 閉会の挨拶 中村 芳明（日本表面真空学会 関西支部 支部長）

問い合わせ先：（一社）表面技術協会 関西支部 事務局（担当：石川・森）
〒606-0805 京都市左京区下鴨森本町 15 番地
電話番号：075-781-1107 FAX 番号：075-791-7659 E-mail: kansai-office@sfj.or.jp
申し込み締切り： 2026 年 1 月 16 日（金）

申し込み方法： <https://www.jvss.jp/chapter/kansai/hyoumengijutsu2026/>
のフォームからオンラインで申込みください。

会場案内： 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 森之宮センター
〒536-8553 大阪市城東区森之宮 1-6-50（アクセスマップ www.omtri.or.jp/map/）
JR 大阪環状線（北口）または Osaka Metro 中央線・長堀鶴見緑地線森ノ宮駅（4 番出口）下車。中央大通を東に約 350m（徒歩約 5 分）、「森ノ宮公園住宅前」を左折し北に約 350m（徒歩約 5 分）。